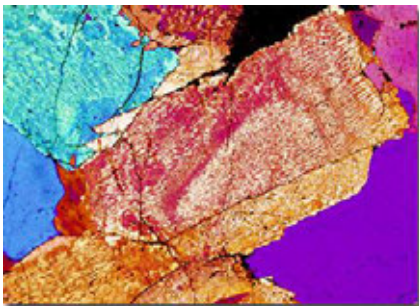
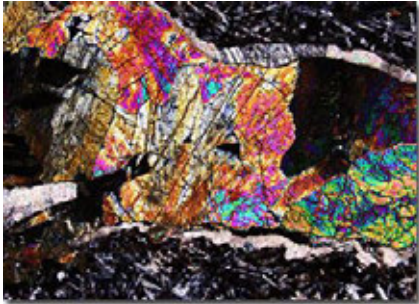
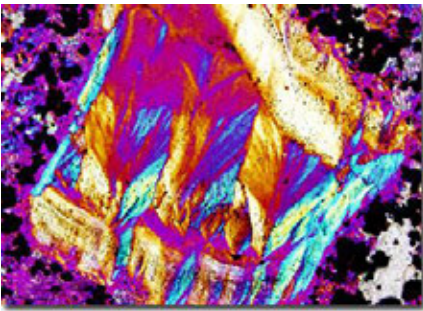
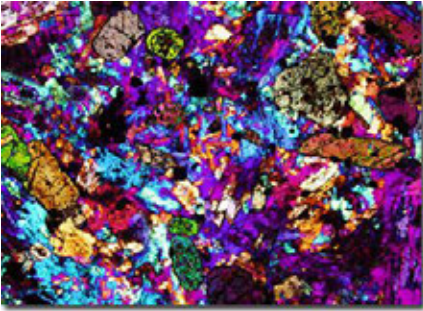


Специализированный прямой
поляризационный оптический микроскоп
Olympus BX53-P



Комбинация поляризованного света BX53M

Оптика комбинации поляризованного света BX53M предоставляет геологам нужные инструменты для визуализации высокой контрастности поляризованным светом. Для таких областей применения, как определение минералов, изучение оптических свойств кристаллов и осмотр срезов коренных пород, полезны стабильность системы и точная оптическая регулировка.

Линза Бертрана для коноскопического и ортоскопического наблюдения

С помощью приспособления для коноскопического наблюдения U-CPA переключение между ортоскопическим и коноскопическим наблюдением происходит просто и быстро. Оно фокусируется для получения четкой интерференционной картины задней фокальной плоскости. Диафрагма поля Бертрана делает возможным получение постоянно резких и четких коноскопических изображений.



Принадлежности для поляризованного света

Оптика без внутреннего напряжения

Благодаря современной конструкции и технологии производства компании Olympus, объективы UPLFLN-P без внутреннего напряжения сокращают искажения до минимума. Это означает более высокое значение EF, что обеспечивает отличную контрастность изображения.



Объективы UPLFLN-P без внутреннего напряжения

Серия UPLFLN-P

Объективы	NA	Рабочая дистанция
UPLFLN 4XP	0,13	17,0 мм
UPLFLN 10XP	0,3	10,0 мм
UPLFLN 20XP	0,5	2,1 мм
UPLFLN 40XP	0,75	0,51 мм
UPLFLN 100XOP	1,3	0,2 мм

PLN-P

Объективы	NA	Рабочая дистанция
PLN 4XP	0,1	18,5 мм

Серия ACHN-P

Объективы	NA	Рабочая дистанция
ACHN 10XP	0,25	6,0 мм
ACHN 20XP	0,40	3,0 мм
ACHN 40XP	0,65	0,45 мм
ACHN 100XOP	1,25	0,13 мм

* Все объективы UIS2 и окуляры WHN: экостекло, которое не содержит свинца.



Ортоскопическая конфигурация BX53M

Коноскопическая/ ортоскопическая конфигурация BX53M

Широкий выбор компенсаторов и волновых пластинок

Для измерения двойного лучепреломления в тонких срезах горной породы и минералов имеются шесть разных компенсаторов. Уровень замедления измерений варьируется от 0 до 20λ. Для простоты измерений и высокой контрастности изображений можно использовать компенсаторы Берека и Сенармона, которые изменяют уровень замедления на всем поле обзора.

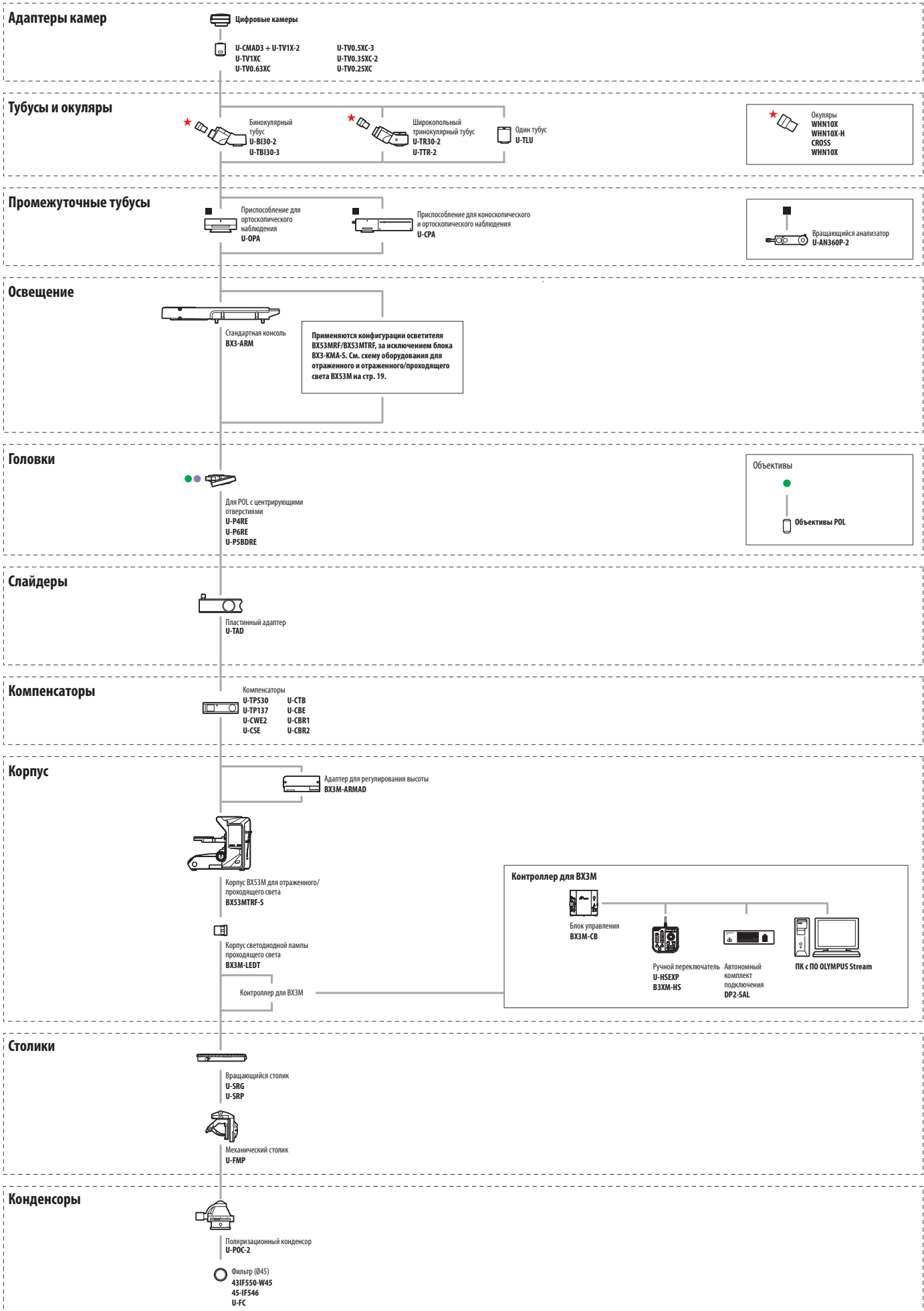


Диапазон измерений компенсаторов

Компенсатор	Диапазон измерений	Применение
Толстый, Берека (U-CTB)	0–11 000 нм (20λ)	Измерение высокого уровня замедления ($R > 3\lambda$) (кристаллы, макромолекулы, волокно и т. п.)
Берека (U-CBE)	0–1640 нм (3λ)	Измерение уровня замедления (кристаллы, макромолекулы, живые организмы и т. п.)
Компенсатор Сенармона (U-CSE)	0–546 нм (1λ)	Измерение уровня замедления (кристаллы, живые организмы и т. п.) Повышение контрастности изображения (живые организмы и т. п.)
Компенсатор Брейса-Келера 1/10λ (U-CBR1)	0–55 нм (1/10λ)	Измерение низкого уровня замедления (живые организмы и т. п.)
Компенсатор Брейса-Келера 1/30λ (U-CBE2)	0–20 нм (1/30λ)	Измерение контрастности изображения (живые организмы и т. п.)
Кварцевый клин (U-CWE2)	500–2200 нм (4λ)	Приближенное измерение уровня замедления (кристаллы, макромолекулы и т. п.)

*R = уровень измерения
Для более точных измерений рекомендуется использовать компенсаторы (кроме U-CWE2) с интерференционным фильтром 45-IF546.

Схема оборудования VX53M (для наблюдения в поляризованном свете)



Технические характеристики BX53M (для комбинации отраженного и отраженного/проходящего света)

		BX53MTRF-S	BX53MRF-S	BXFM
Оптическая система		Оптическая система UIS2 (с бесконечной функцией коррекции)		
Корпус микроскопа	Освещение	Отраженный/проходящий		Отраженный
	Фокус	Ход: 25 мм Точная величина хода за один оборот: 100 мкм Минимальная градуировка: 1 мкм С ограничителем верхнего предела, регулировкой вращающего момента для рукоятки грубой настройки		Ход: 30 мм Точная величина хода за один оборот: 200 мкм Минимальная градуировка: 2 мкм С регулировкой вращающего момента для рукоятки грубой настройки
	Макс. высота образца	35 мм (без прокладки) 75 мм (с BX3M-ARMAD)	65 мм (без прокладки) 105 мм (с BX3M-ARMAD)	Зависит от конфигурации размещения
Тубус для наблюдений	Широкопольный FN 22	Инвертированный: бинокулярный, тринокулярный, бинокулярный с наклоном Прямой: тринокулярный, бинокулярный с наклоном		
	Сверхширокопольный FN 26,5	Инвертированный: тринокулярный Прямой: тринокулярный, тринокулярный с наклоном		
Освещение отраженным светом	Традиционная методика наблюдения	BX3M-RLAS-S Кодированный белый светодиод, BF/DF/DIC/POL/MIX FS, AS (с центрирующим устройством), взаимоблокировка BF/DF BX3M-KMA-S Белый светодиод, BF/DIC/POL/MIX FS, AS (с центрирующим устройством), взаимоблокировка BF/DF BX3M-RLA-S Галогеновая лампа мощностью 100/50 Вт, белый светодиод, BF/DF/DIC/POL/MIX/ FS, AS (с центрирующим устройством), взаимоблокировка BF/DF, фильтр ND		
		—		U-KMAS Белый светодиод, галоген мощностью 100 Вт Волоконное освещение, BF/DIC/ POL/MIX
	Флуоресценция	BX3M-URAS-S Кодированная ртутная лампа мощностью 100 Вт, 4-позиционная турель модуля зеркал (стандарт: WB, WG, WU+BF и т. д.) С FS, AS (с центрирующим устройством) с механизмом затвора		
Проходящий свет		Белый светодиод Конденсоры Аббе/с большим рабочим расстоянием	—	
Револьверная головка	Для BF	Шестикратная, центрирующая шестикратная, семикратная, кодированная пятикратная (дополнительные механические револьверные головки)		
	Для BF/DF	Шестикратная, пятикратная, центрирующая пятикратная, кодированная пятикратная (дополнительные механические револьверные головки)		
Столик (X × Y)		Столик с левой (правой) коаксиальной рукояткой: 76 мм × 52 мм, с регулировкой вращающего момента Большой столик с левой (правой) коаксиальной рукояткой: 100 мм × 105 мм, с механизмом блокировки по оси Y Большой столик с правой коаксиальной рукояткой: 50 мм × 100 мм, с регулировкой вращающего момента и механизмом блокировки по оси Y		—
Масса		Прибл. 18,3 кг (корпус микроскопа 7,6 кг)	Прибл. 15,8 кг (корпус микроскопа 7,4 кг)	Прибл. 11,1 кг (корпус микроскопа 1,9 кг)

Технические характеристики BX53M (для наблюдений в ИК)

		BX53MRF-S	BXFM
Тубус для наблюдений в ИК	Широкопольный FN 22	Инвертированный: тринокулярный	
Освещение отраженным светом	Наблюдение в ИК	BX3M-RLA-S Галогеновая лампа мощностью 100/50 Вт для ИК, BF/ИК, AS (с центрирующим устройством) с полосовым фильтром (1100, 1200 нм) BX3M-URAS-S Галогеновая лампа мощностью 100/50 Вт для ИК, BF/ИК, AS (с центрирующим устройством) с полосовым фильтром (1100, 1200 нм) и механизмом затвора	
		—	U-KMAS Галоген мощностью 100/50 Вт для ИК, BF/ИК
Револьверная головка	Для BF	Шестикратная, центрирующая шестикратная, семикратная, кодированная пятикратная (дополнительные механические револьверные головки)	
Столик (X × Y)		Столик с левой (правой) коаксиальной рукояткой: 76 мм × 52 мм, с регулировкой вращающего момента Большой столик с левой (правой) коаксиальной рукояткой: 100 мм × 105 мм, с механизмом блокировки по оси Y Большой столик с правой коаксиальной рукояткой: 150 мм × 100 мм, с регулировкой вращающего момента и механизмом блокировки по оси Y	—
Масса		Прибл. 18,9 кг (корпус микроскопа 7,4 кг)	Прибл. 11,6 кг (корпус микроскопа 1,9 кг)